

# 近赤外対物レンズ (M ePLAN NIRシリーズ)



YAG用(1064nm)加工用の  
高NA無限遠補正対物レンズです。  
明視野観察にも使用できます。



- 特徴**
- 無限遠補正光学系
  - 可視域(640nm)と近赤外域(940~1064nm)まで補正設計されています。
  - 高分解能仕様
  - 同焦点距離45mm
  - 50X対物レンズは、作動距離が調整可能
  - 100X N.A.O.7対物レンズは保護ガラス付き、ハイパワーレーザ耐性

仕様	倍率	開口数 N.A.	作動距離 WD(mm)	焦点距離 f(mm)	分解能 R(μm)	焦点深度 ±D.F(μm)	実視野 (φ25接眼, mm)	実視野 (1/2CCD, mm)
M ePLAN NIR 50	50X	0.65	3.1-3.83	3.6	0.42	0.65	φ0.5	0.1x0.13
M ePLAN NIR 100	100X	0.75	3.4	1.8	0.37	0.49	φ0.25	0.05x0.06
M ePLAN NIR 100A	100X	0.8	3.3	1.8	0.42	0.43	φ0.25	0.05x0.06

# 近赤外対物レンズ (M mPLAN NIRシリーズ)



YAG用(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。  
明視野観察にも使用できます。



- 特徴**
- 無限遠補正光学系
  - 可視域(640nm)と近赤外域(940~1064nm)まで補正設計されています。
  - 高分解能仕様
  - 同焦点距離60mm
  - 50X対物レンズは、作動距離が調整可能
  - 100X N.A.O.7対物レンズは保護ガラス付き、ハイパワーレーザ耐性

仕様	倍率	開口数 N.A.	作動距離 WD(mm)	焦点距離 f(mm)	分解能 R(μm)	焦点深度 ±D.F(μm)	実視野 (φ25接眼, mm)	実視野 (1/2CCD, mm)
M mPLAN NIR 50	50X	0.65	3.1-3.83	3.6	0.42	0.65	φ0.5	0.1x0.13
M mPLAN NIR 100	100X	0.75	3.4	1.8	0.37	0.49	φ0.25	0.05x0.06
M mPLAN NIR 100A	100X	0.8	3.3	1.8	0.42	0.43	φ0.25	0.05x0.06

株式会社渋谷光学  
Shibuya Optical Co., Ltd.

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3-22-2 Tel:048-469-1200 Fax:048-469-1311  
3-22-2, Shimonikura, Wako-Shi, Saitama Pref., Japan 351-0111 Tel:048-469-1200 Fax:048-469-1311

URL : <http://www.shibuya-opt.co.jp>